

F3-CS

薄膜厚度测量仪



Filmetrics 设计 F3-CS，主要针对于微小视野及微小样品测量设计。从产线的操作人员到技术人员都可以在短时间内测试比如聚对二甲苯和真空镀膜类膜层。

我们的专利自动基准校正功能缩短了测量前期搭建和机械化校准。在免提模式下，仅仅需要设定薄膜上下层信息就可以测量。系统可以测试数以百计的类型的膜层，不论是透明或不透明的基底材料。

快速厚度测量

选配 FILMeasure 厚度测试软件升级，当设定好样品信息后就可以很容易的测试膜层厚度。包括通常的介质材料和半导体层（包括 C、N 和 HT）。厚度数据结果在短时间内就可以在测试结果中显示。针对更高级的用户，F3-CS 也可以升级至测试反射率。F3-CS 在 Windows XP™ 到 64-bit Windows 8™ 系统中都可以运行，并且一个 USB 线就可实现电源供应及通讯连接功能。

Filmetrics 的优势

- 桌面型薄膜厚度测量的全球领导者
- 24 小时电话，Email，在线支持
- 直观的分析软件

附加特性

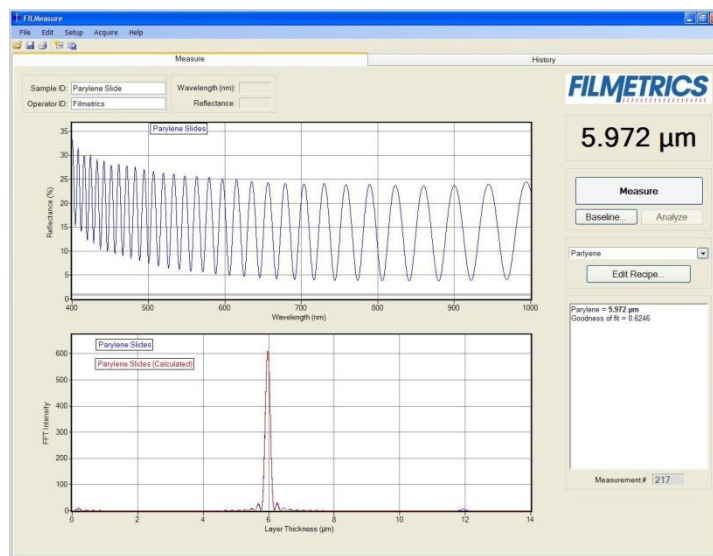
- 嵌入式在线诊断方式
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测试结果

免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

F3-CS

薄膜厚度测量仪



使用简易界面测试聚对二甲苯膜层厚度的 F3-CS

	F3-CS-UV	F3-CS	F3-CS-NIR	F3-CS-XT
波长范围:	200 nm -1100 nm	380 nm - 1050 nm	950 nm - 1700 nm	1440 nm - 1690 nm
斑点尺寸:	100 μm	100 μm	100 μm	100 μm
光源:	外界氙灯和钨卤素灯		内置 40k-hr 寿命	
厚度测量¹				
厚度测量范围:	3 nm - 40 μm	15 nm - 70 μm	100 nm - 250 μm	0.2 μm - 450 μm
最小测量 n 和 k 范围 ² :	50 nm	100 nm	500 nm	2 μm
准确度: 大于 0.4%或	1 nm	2 nm	3 nm	5 nm
精度 ¹ :	0.05 nm	0.05 nm	0.2 nm	1 nm
稳定性 ² :	0.05 nm	0.05 nm	0.12 nm	1 nm
光谱仪	操作系统			
波长准确度:	< 0.5 nm			
波长重复性:	0.1 nm			
噪音	< 0.0002 A rms			
杂散光:	500 nm 处< 0.25%			
电源:	USB 供应			
			PC:	Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)
			Mac:	OS X Lion/Mountain Lion
			接口:	USB 2.0

¹ 厚度测量需要选配 UPG-RT-to-Thickness。光谱比较模式取决于材料。

² 指数测量需要选配 UPG-Thickness-n&k。



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

